



第17回光学シンポジウム参加報告

精 松 淳

大日本スクリーン製造(株)技術研究所 〒602 京都市上京区堀川通寺之内上ル4

第17回光学シンポジウム「光学系の設計、素材、製作、評価を中心にして」が1992年6月25日、26日、梅雨時には珍しい天候に恵まれ、東京大学生産技術研究所で開催された。参加者は250名近くあり、副題が示すように半数近くの参加者が光学設計に携わっているようであった。本シンポジウムは年々盛況になり、今年は2日間開催されることになった。新しく8件のポスターセッションが設けられ、招待講演も増えて5件、一般口頭発表16件、合計29件の発表があった。

一岡芳樹日本光学会幹事長（阪大工）の開会の挨拶に続く、招待講演第1講山口一郎氏（理研）「光干渉計測の最近の進歩」では、デリケートな干渉計測と最近の技術（半導体レーザー、ファイバー、コンピュータ）が結びついて、高精度な計測が次々と現場レベルで実現されている状況が話された。

昼前の「ポスターセッション・ショートプレゼンテーション」では、1件3分で発表内容が紹介され、続いてのポスター発表（12:00から13:30までは発表者が説明し、17:30までは掲示のみ）への良い紹介になった。

初日最後は招待講演第2講、松居吉哉氏（キヤノン）の「技術屋の人間的側面」であった。講演では、海外から日本の経済進出の風当たりが強くなった現在、われわれ技術屋が根源的に考え直さなければならない点を話され、「how to」（問題の対処）に留まらず「why」（問題の本質追求）に向けての技術者の姿勢が今まで以上に重要なになってきており、欧米のキリスト教文化（教義の内容が誰にでもわかるように具体的に示される）とわが国の仏教文化（悟りを開いた人からお経のように一方的に与えられる）を対比しながら、光学系設計でも誰にでもわかる形で（近軸論や収差論）整理していくことの大しさの上に創造性、独創性があると主張された。一聴衆としても、日頃から気に掛かっている「小さくてもいい、自分なりの独創的な仕事をするには？」と言う間に對し、長年光学設計されている松居氏の考え方が示され感銘を受けた。

講演終了後の懇親会では鶴田匡夫日本光学会前幹事長（ニコン）の挨拶と乾杯の音頭で懇談が繰り広げられた。新しい技術成果が聞けるとともに光学関係の研究者、技術者の近況を交換しあえる楽しい懇談会であった。

2日目最初の招待講演第3講は本田捷夫氏（東工大）による「SPIE国際会議 (International Symposium on Optical Fabrication, Testing, and Surface Evaluation) 報告」であった。'92年6月10日から12日、富士フィルムホール（本社）にて参加者182名、講演69件（招待16、一般53）の概要で開かれ、この内、光学会に關係するもの20件で他はX線関係ないし精密加工に関するものであったとのことであるが、2週間前のホットな情報で、予稿集にも間に合わなかった内容が新鮮であった。

午後一番の招待講演第4講、鈴木正根氏（名古屋造形芸術大）「ニュートンゲージの規格化」では、ニュートンゲージがJIS規格に制定されるまでの経緯、今後の問題点、現在も進められている校正用測定機開発についての話があった。

招待講演第5講、吉野公夫氏（特許庁）「レンズ系特許の審査について」では、特許制度のあらましに統いて、収差補正したレンズ系特許の審査基準にはC、B、A発明があり、各々についての具体例が示された。レンズ系特許に携わっている幾人かの発明者（？）から「C発明の数値的権利範囲は？」、「B発明の数値不等式の根拠は確かめるのか？」、「引例に引かれたA発明の進歩性は？」等の迫力のある質問が次々と出されていた。

一般講演は、詳細については触れないでおくが、「光学設計・製作」に関する件数が一番多く、次いで「干渉を利用した光学素子などの評価、測定」、「その他の光学測定機」であった。

最後まで会場一杯の参加者で熱気のある討論が続けられ、一色真幸氏（東京工芸大）の閉会の挨拶で終了した。

(1992年8月10日受理)